



JOURNEE THEMATIQUE DES RESEAUX FEMTO ET ROP

TENUE AU FLUX EN REGIME FEMTOSECONDE

7 décembre 2011 – 10h00
Palaiseau

Les performances des sources laser femtoseconde sont de plus en plus élevées tant sur le plan de l'énergie que sur celui des courtes durées. Les composants utilisés dans ces sources requièrent à la fois une large bande spectrale, une dispersion de vitesse de groupe faible, une haute tenue au flux et parfois des grandes dimensions transverses.

Lors de cette journée seront présentés les aspects fondamentaux de l'endommagement en régime femtoseconde ainsi que les traitements optiques augmentant le seuil d'endommagement.

Les potentialités industrielles mais aussi les contraintes liées à la réalisation seront aussi présentées.

9 :00 – 10 :00	Accueil	
10 - 10 :20	A. Bonvalet	
	L. Gallais	Présentations des réseaux FEMTO et ROP
10 :20 – 10 :50	C. Le Blanc	Les spécificités et les besoins sur les systèmes intenses
10 :50 – 11 :20	O. Uteza	Endommagement laser en régime ultrabref (< 10 fs - 100 fs)
11 :20 – 11 : 50	L. Gallais	Impact du polissage et des traitements de surface sur la tenue au flux
12:00 – 14:00		BUFFET
14 :00 – 14 :30	N. Bonod	Réseau de diffraction pour la compression d'impulsions: Comment réduire les renforcements de l'intensité lumineuse dans le réseau et offrir une très haute efficacité de diffraction?
14 :30 – 15 :00	J. Néauport	PETAL : Les réseaux de diffraction
15 :00 – 16 :00	REOSC Jobin-Yvon	Les contraintes et les réalisations industrielles

Contact : Gilles Chériaux
gilles.cheriaux@ensta-paristech.fr